

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06176998 A

(43) Date of publication of application. 24.06.94

(51) Int. Cl

H01L 21/027

(21) Application number: 04352608

(22) Date of filing: 10.12.92

(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING **APPARATUS** 

(57) Abstract:

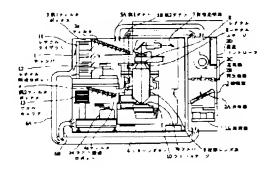
PURPOSE: To make a chamber small-sized without producing a dead space in the chamber.

CONSTITUTION: A first filter box 3 is arranged and installed in a dead space part at the upper part of a reticle library 11 inside a chamber and of a reticle conveyance robot 12, a second filter box 4 is arranged and installed in a dead space part at the upper part of a wafer carrier 13 and of a wafer conveyance robot 14. and they are made to communicate with the discharge side of a blower 2C inside a machine chamber 2 by a first duct 5A and a second duct 5B. A reheating device 2B and a cooler 2A are arranged and installed on the intake side of the blower 2C inside the machine chamber 2, at least one out of both is controlled by a temperature controller 2D, and an atmospheric gas is air- conditioned to a prescribed temperature and sent to filter boxes 3, 4. The filter boxes 3, 4' discharge a lean atmospheric gas from respectively tilted outlet faces.

(71) Applicant: **CANON INC** 

**NAKANO KAZUSHI** (72) Inventor: **KOSUGI MASAO** 

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



# ·Bell slighter of the All 公開特許公報 A

三日 特許出願公開番人

## 特開平6-176998

(4) 23開日 学院6年(1994)6月24日

(51) Int Cl.

識別記号 「自内整理番号」

F I

技巧者 5萬四

HOIL 21 027

735, 4M

HOTE 1 50

.001

審査請も「未請す」請求項の数6 (合10頁)

(21)出願番号

特願 中4 - 352608

(22) 出験自日

手版 4 年(1992)12月10日

(71) 出願 ! 000001007

对流失群 12 世纪

東元都大田区土夫子3丁目10番2号

(72) 毎明者 中野 ここ

神だ川県川崎市中原区全井上町の雷地。キ

サフン株式会社小科事業所内

· 維尔巴思川崎市中原区今共上的35番地。天

マプン株式会社小科事業所的

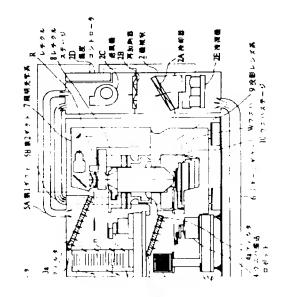
信任代理人 室理士 除水 美朗

#### (54) 【発明の名称】半導体製造装置

#### (57)【要約】

【目的】 チャンパにデッドスペースが生じることがな く、チャンパを小型化することができる。

【構成】 チャンパ1内のレチクルライブラリ11とレ チクル撤送ロボット12の上方のデッドスペース部には 第1フィルタボックス3が、ウエハギャリア13トウエ ら継ぎによっちてはの上りのテットの。一て部には第2 ことルタ おックス 4 かそれぞれ配設されており、第18 とおうさいに対してととおおおしょうそととも 極機テム 104 風機2(100 出側に連通されている。また、機械デ 2 内の正風機2での吸込側には再加熱器2 Bおより高却 器2Aを配設し、両者のうちの少くとも、方を温度コン 下に一つ2Dによって制御することで雰囲気気体を所定 温度に楽調して配記してルタボックで3、4、びる。町 記してルタナックス3、4ほそれぞれ傾斜する物出し面 



#### 【特許請求与範囲】

【請求項1】 チャントので、傾向する明出。面を有するフェルタボックスが備き、前記チャントのの室間が頂 記27・ルタボックスを介してチャンと外部に設けられた。 と調手段に連通されてエッを特徴とする主導体製造装 置

【請求項2】 キャンパトに曲面状の吹出、面を有力で エデルタナックタを備え、前記チャンパ内の空間が可記 ファルタボックタン全。でチャンパ外部に設けて空間手 投げ連通されたことを特徴とする主導体製造装置

【請す項3】 欧田、面か、フィルタによって形成されたことを特徴とする請水項1または2記載の半導体製造 装置

【請す項4】 助出し面に網体によって形成されており、字記網体との間にを開節を設けた利能でディルタの配設されていることを特徴とする請求項1まだは日記載の主責体製造装置。

【清水項5】 チャンへ内り複数力部位にそれぞれフィールタナックスが配設されたことを特徴上する清水項1 5 全 4 いずれが1項記載の主導体製造装置

【請求項6】 チャンと内に、複数のマテック本体を配設するとともに、前記ファッパ本体に付設される間に機器増加うちの機働率の低いもつを少な、とも1組状用できるように設けたことを特徴とする請述項1万至5いでれか1項記載の生産体製造装置。

#### 【発明の註細な説明】

### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チャンへ内の雰囲気気体の高精度に空調された主導体製造装置に関するものである。

#### [0002]

【延来の技術】従来、事導体素子の製造や検査に用いられる各種装置は、事導体素子の高集積化やパターンの微細化にともなって、精度や歩留りのより一層の向上が要請されている。

【0003】上記要請に答えるには、事尊体製造装置や 梅春装置等を均っに空調された雰囲気気体中に配設する と要かもり、特に、少切り配と与要達に等しるには、聖 はより飲事製料の異なったい活浄な雰囲気気体中に配き まする要いする。そこの本点刺ればにはいて、1まりは 体露光装置を標案した。特別では、2511とり、報告 暗。

【0004】[410にかまように、チャンパンの1円を複数の空間A ~D に分割り、空間A 、D を第1 と 岩調手段302、岩間C を第2つ空調手段316元。空間Bを第3つ空調手段317にそれそれ連通させたもってた。

₩ を支持することができいるとし、310、空間D 計画して キャルライマのじ311およびにそりの撤送は カントは10、ウェバキャリアは13ねよびウエバ搬送 ロボード314つそれぞれ配設されている。空間A、と 空間10、八大井流にはフェルタブ、クス305小配設さ おており、空間A ははフィキタ303、空間D では 7、4.タとの4を通して、第11回週11段30日で週間 された雰囲気気体でも引き気を清浄化してタウンフロー 700円され、空間( こばば) アルル318参通。"5篇は 10 与空間手段3.16で空間された空気が清浄化して吹出さ 世、学問も「にはフィルタ319を通して第3の空調手 段3.17で空調された空気を清浄化して呼出させるよう。 で構成されている。ここで、各空間A へD の出しる (世の語気で温度は、例えば、空間A および空間B 内 ごうれると配設した温度が、サスエラA、BISBの検 |出温度に基いて、温度コントロー・30日Dを介して各 空調手段302、316、3170各送風機302℃。 3.1.6() 3.1.7() 5吋 ビ明に配置された冷却器3.0.2 Po 6 B フェアむをそれそれ制御するようにより調節でき るように構成されている。

#### [0000]

【発明が解決しようとすり課題】、かし、上記後来が技術では、チャンの内の複数に分割された空間にそれぞれ 更面状の内間し面が有するファルタボックスを配設しているため。チャンへに古めるファルタボックスの容積が大きく各空間毎にデットスペースが生し、チャンっか大型化せる。

【0007】またデャン、内には、堅明光学系、レチク30 ルスケーン、投影レンフ系およびウエバステートを備えたスティバ本体が一台設けられ、各一台ずつのウエバ搬送ロボットやレチクル搬送ロボット等のスケッパ本体に付設される周辺機器類が設けられているが、これらの周辺機器類もウエバサイフが大径化するにつれて大型化レでチャンが内に占める容積が増大し、イニシャルコストおよび行にニンクコストを高騰させるという末解決の課題がも、イ

【〇〇〇9】また、子、、マルコス。およびコニュンクコストの加減できるお導体製造装置を実現することを映る上的とするようようようととる。

#### [0010]

【0011】さたに、ペッショ内に、複数のスペートを |体を配設するとともに、前記スケット本体に付設される。 周辺機器類りられた検衝すり低いすびありなりとも1組 毎用できるように設けたものとすると効果的である。

#### [0.012]

【作用】半調手段により空調された雰囲気気体は、フィ ルタによって濾過されて清浄化され、ファルタボックス の傾斜でそ呼用。面または曲面状の吹出し面から吹出さ えいぶのご 傾斜でる吹出し面の傾斜角度または曲面状 り 映出た面が曲本を適宜改定することにより、チャンとは ご配設された各種機器に対応した方向の清浄化されて雰 囲気気体の気流を発生させることができるとともに、従 刺倒ではディトスープとなるチャン 国内の部位に 1 · はりボログスを配設することができる。

なのステリー 4体に対して稼働率の低い周辺機器がまた。 (上も)組出用できるように設けられているので、チャ 三へ付で占める監査が減いする

#### [0.014]

【国駒例】本発明の実施例を図面に基いて説明する

【0015】図1は、本発明の空調装置の第1実施例の。 説明何である。図1に元十ように、チャンパ1内には、 町時内位系でおら脛射される照明元の光路に沿って、レ -4 11ルRを支持するためのレチクルスゲーン8、投策レ ンズ系9、およびウエハWを支持するためのウエバステー30。 一二10か順次配設されており、その側傍の上方部位に はレチクルライブラリ11およびレチクル搬送装置であ えレチクル搬送ロボット12、下方部位にはウエハキャ リア13およびウエハ搬送装置であるウエハ搬送ロボッ 5.1.4がそれぞれ配設されている。

【ロ016】レチクルライブラリ11ミレチクル搬送は ボント10の上がのビートストース部には、レギケルシ アプラリエイ ひとちざば レスクカ機さい かっとしばて木 Application とことのは、自う臨失れたちの傾斜と例れば 全体存までは、 タビーサスで表す。 かんりひょうしょ 第17月49年7月7日35、225年6年7月1日 ジュ 小搬送 ロミットエ4 5十 かりゃくち イー・多部活は ウェスキルトグ185上がい合わた。搬送ロオール14 ひ上方でって、その吹出し面が臨む やきぎの傾斜する 政制に面を有する フィルタボ デケスだらる。 リケスルタネ 正をも、第2~にルタポックの4かそれぞれ配設されて かんしゅんじゅ 踏むし しんいしょ しんけいけい こうごくご

けばり 英ピコンダタか ここく4 (4第ピタニックB)によ し、イズ元素機械至じり迁風機じじた欧出側で連通され たいろ、前記 といよをひょ、するは、夜世寸ら第2年紀 例のものと外形の異なるたけて実質的に同様であるの。 て、その説明は省略する

【0017】 ニニコ、第1カ フェルタコー とよ3 を保に たけて、映正されて清浄な研製気はで流れて、いて説明

【0018】[42は[初1に示けしずでルライン とりむり 10 - 西清浄紫囲気気体の記むを出せ説明だてから

【0019】国は、1世よりに、レサクルライブコリ1 1 かしチグルR 列取制 またべむ 開校された 取出し面 もご 対に傾き角状を打たせ、レボリルがデプラリエエットを たにしげ クル搬送ログットエピ ひわたに かごこうその吹 出し面が臨り大きさが傾身大名映出を面をも (第12)で マルタボックスコン配設されている。第1072年タボ - ケスはの傾斜する映出し面いる映出される空調された 請浄本囲気気体は層流状態を保むないのに行りようイブ ラリ11内からPPの間隔で積重してわたいチグルRに到 【0.0.1.3】また。清末項6に係る発明においては、複(20 達する)にそりませばそりにそりにそりに高い端記取出に由n こ 対して垂直となりように配置されているため。 名詞さ れた清浄な洪気気体はレモクスRに到達したのちレモク |集働に記して記れて、美国の同じ第1カフェルタボック スコにレナグル搬迁習路を覆うように配設されているた メール デクル搬送 経路 中のレポ グルRのまわり 生間む 清浄雰囲気気体で満たされている。

> 【0020】ついて、傾斜する吹出し面の傾き角もにつ いて説明せる

> 【0021】国2において、レチャルライフラリエエの |2枚カレチフルRに抖 もれた流路面積 s / コ空間に流れ る清浄雰囲気気体の流路Q′は、この流路面積 s´の前 記吹出し面に控算した面積もから吹出される清浄雰囲気 気体の流量Qにほぼ等しい。すなわち、傾斜する吹出し 面から吹出される清浄雰囲気気体の平均流連を立、流路 面積く1の空間を流れる清浄雰囲気気体の下均流速を v とし、損失を無視すると次式が成り立つ。

$$\begin{bmatrix} 0.0022 & -8.8 & 8.8 & 8.8 \\ -8.8 & 9.6 & 9.6 & 9.6 \end{bmatrix}$$

T 11 0 0 1 1

0.00 - 0.00 = 0.00 + 0.00 = 0.00 + 0.00 = 0.00全概 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 数 5 处罚 5 4 4 5 5 6 5 6 6 2 m [301] [6回 7年7望日 [5] 日ご 7・4 4 3 A を映出し正と、当場合、第1 さんかりかい りんげんごり |拠別に「さまけ最大主命」にい美明紀四月による。まなが 4) ピーパイン 10、2m - n、v' - 1 m - くを代入

フェンタナーでのは、複数で嫌き角を持一時間。重く構成しても良いことは自用である。

【0024】また。ディナムの外部に設けられた原謝す 段は、次のように構成されている。

【0025】機械率2円り送風機2での吸込制には再加熱器2B紅よび合却器2Aを配設し、チャドハ1円り第1m・4 タナッサス3力之修には温度センド15を配設し、温度サドサ15 つ検出温度に基づて温度をショローン2Dにより再加熱器2B力加熱温度または合却器2A力合却温度のらた力を15年、力を制御することによて第17年ルタホックス3わよび第27年ルタホックス4よりチャジの1円の出出す清浄雰囲気気体の温度を呼返温度に調節1、2要ならば湿度調節手段を併設して呼返力環度に調節できるように構成されている

【0026】 4実施例の動作について説明するこ、分岐管6A、6Bを介してリターンタクリ6により回収されたチャンパ1内の雰囲気気体は、機械室立で研定り温度に名調されたのち、第1 ギケト5Aおよび第2 タット5Bを通じて第1 ファルタホッケス3 および第2 ファルタサッケス4 ~ それぞれ供給され、第1 フェルタボッケス 203 ウィナルタ3 a および第2 ファルタホッケス4 a によってそれぞれ濾過されて清浄化され、チャンパ1内の再び吹出された有浄雰囲気気体は、傾斜する吹出し面に対して垂直方向の気流となって吹出され、チャン・1 内の各種機器類はそれぞれ清浄雰囲気気体中に適ることができる

【00027】次に「本発明の第2実施例について説明する。

【0028】本実施例は第1実施例における傾斜した映 30出し面をもつフィルタボックスにかえて曲面状の映出し面をもつフィルタボックスとした点以外は第1実施例と同様であるので、第1実施例と同様の部分は同一符号を付してその説明は省略し異なる部分のみについて説明する。

【0029】図3に出土ようにレチクルライプラリ11とレチクル機送コポット12の上方のチェトスニース部には、曲面が「時円」画を有するロデルをサークローをデース・デアココディーをデー、デーニーにはは一部に対し、エイントラー、デーディアをついてある。「エルタ24日をする第21十年アポットス24日を表示というには接接したチャンへ15個壁にはそれぞれリターンタクト6つ第1回映管6入むよび第2分映管6日か連通されている。

【0030】第1日とはカナックタリコは第1カランニ

【0033】、、りぎょうで33は、提出形状の略上を用しな体が36を有し、な体が30、と開放部に取付けるれたで、4233には一つ出版を表す。第310円成立た。箱型がたりであって、1、4233に対応する壁面には管状が連通部33十二歳にられている。本意形向では、1、4233に対抗が通過部分が表別のようで、433は一つによりでは433に、2間数部端は33とに確めらみ図のこないでルー等により開放部端は33とに確めらみ図のこないでルー等により開放部端は33とに確めらみ図のこないでルー等により開放部端は33とに確めらみ図のこないでルー等により開放部端は33とに確めらみ図のこないでルー等により開放部端は33とに確めらみ図のでは45で、423に対抗が35とでは36年を保む、本国気気体がで、423に対抗されている。

【0084】同5は、第2変形例りででルタルのカスを 5十階高国である。

【0035】 ファルタナーとフォコは、関語が永少幅有字形の本体43~を存し、本体41)、当開放部に取付られた網体43~により曲面料の映出。面が形成された箱型の大りであって、網体43~の開放部の端縁部43トに概合させた上、図が一ついれて第を用いて固省し、前記開放部の端線部の面には前記網体43~との間に空間部を設けた状態で半型ファルタ43~を配設し、平型ファルタ43~ではあた対向する壁面には管状の連通部43~か設けられている。

【0036】本変形例においても、平型ファルタ43aは、カラフ繊維製等の適材を何重にも畳み折りし、その両端面および両側面を枠43dに接着剤を用いて接着しておき一枠43dを本体43cの開放部の端縁部43hに低め込み、こり枠43dを図っしないホルト等により固着し一両者り同間にはコーキング剤を詰め込んで気密性を保つように構成されている。

[06 (8] 37 (150 90) [ 37 (15 )

【のの3の】 「ヤー」 ヤヤドのにより 無視されたさい。 1 中で変更気にゆけ、核構を立て地定り温度に空間さ まったれ、第 1 タフト5 Aおよび第2 タフト5 B を通じ で第 1 ファリタナーファンコおよび第2 フェッタナーフ イン34 っそれぞれ供給され、第1 フィリタナーフィン3 3. 2月で曲面駅で吹出し面に対して法線も向かり流っ ない、中出され、デザント1所の各種機器はそれそれ情 浄寒囲気気体の気流中におくことしてきる。

【0040】この場合、曲面状の時出し面の曲率を適宜 設定することにより、デヤント内に配設された各種機器 に対応した方向の清浄本開気気体の気流を発生させ、これらを清浄に保っことができる。

【0041】次に な始明の第3美麗樹にしいて説明士 当

【 0 0 4 2 】 図 6 に、第 3 実 短 例 の 模式 構成 図 て あっち 1 1 6 においては 空調 手段や マイルタナック ス は 図 ポープ いない

【0043】図6にホナように、チャン/101円には、第1のファッハ本体S。と第2のステッハ本体S。との間隔をよいて併設されている。第1でステッハ本体S。と第2のフナッハ本体S。と第2のフナッハ本体S。に、それぞれ、照明光学系107、207から照射される照明先の光路に高って、順次配設された、レチクルR。R。至支持するためのレチクルマデージ108、208、投業レンス系109、209、ウエハW。W。至支持するためのウェバ 20ステージ110、210とを備えている

【0044】第1のコテッハ本体S 中華2のスケッパ本体S。の間のチャンコ101で上方部位には第1のステッパS 用の第1のレチクルライブラリ111と第2のステッパS 用の第2のレチクルライブラリ211分配設されており、その下方部位には、第1のステッパ本体S。用のウエハキャリア213が配設されている。第1のステッパ本体S および第2のフテッパ本体S に、それぞれ不図示の露光光顔より照射された光東が、照明光学 30系107、207を通ってレチクルステーシ108、208に支持されたレチクルR。R、を明明し、投影レンス系109、209によりレチセルR。R、上のパターンをウエーフテージ110、210に真空吸着されて位置決めされたウエーW。、W 上の感光層に転写するように構成されている。

【0046】制御装置100は、第1のコ・ッパ本体5 と、第2のステ・いれ体5 とを制御すごしゃもに、 レグクリ搬送ココント112まといウは、搬送ロカント 114節の間の機器箱を制御するものであった。CPU - アを利謝して肉の手順を得める

【0017】演算回路100Bは、名にストーン原理で よしくとよりは劉依鏡114を合はウエい顕微鏡119、2 19の検出結果などがよしてリチウルR 、R。とウエトW 、W の相対位置を演算するなどの連件と高精度を要 水される演算処理を行い、メデビ100Cにされても制 定準一度な演算でいると記憶する。

【0048】図では、 松田絶倒 5円は 5 痩 ほけが 3 ちか 搬送経路を説明 土名模式下面図である

【0049】ウエト操送にカット114は、カイト115に案内され、両ウエバキャリア113、213に納められ 位復移動し、ウエバキャリア113、213に納められたウエバW。、W を交互につシト14Aで保持してフ リアライメントステージ116、216に搬送する

【0050】 フリアタイメントスタージ116, 216 では、ウエハW 、W. アプリアライメントが交互に行われ、そのと子後、ウエハW 、W. は供給ハンド116A、216Aにより各ステーハ本体8 、S. のウエハスゲージ110, 210に空耳に供給され、一連の位置合わせ露光工程の気化に行われる。つより、2台のステラハ本体8 、S. に対し1台のウエノ機造ロボット114によりウエハW 、W. の供給、何即を交互に行うことのできる。

【0051】図8は、上述した第1のステーハ本体S 、第2のタテーハ本体S およびウエハ株送ロボット 114のシーケンスを横軸に時間をとってよわしたもの である

【0052】図8より、各ステッハな体8 、 8、の稼働時間に対し、ウエー搬送ロボート114の稼働時間は0 短点、2台のステッハ本体8 、 8、に対して1台のウエハ搬送ロボット114でウエハW 、 W。を交互に供給および回収を行うことができることがわかる。このことは、後述するレチクル搬送ロボット112についても同様に言えることである

【0.9.5 5】。 そり (親近は1 - 51.1.2)になるト1.1 2 A 応案的 5 4、 成に そりまり 4つ ップ 1.1.1、 2.1.1 5関を可複移動 、 各に もりまって 5 - 1.1.1、 2.1 1 活動がなかな もりまな R 、 R 、 かハ、ト1.1.2 A で

R の無線はなり無線は1米のよりショイトでは ではなれる とまた、2分にスケーの基体を 1 8 字 対し上行がは チグル搬送に歩いるによりレチグルR 。 R. い供給および回収を交互に行うことができるように 構成されている。

【0.0.5.6】 上述したように本実施例においては、200 2008年 - 44448 - 1 S - 1対し搬送ロホット1 1 441 よびレチクル搬送やホット112を共用できるとうに設 けたすりてもそなが、設置面積が1.0%~1.5%で有え ハースとなり、ヨスト泊でも、制御装置を含めたロスト。10、【デ4】 4を明り第2実紀に付えて、よ々サックスト てねたとう%~10% カコストタウンとなる

【0057】 4実施例では2台のフザーハ本体に対し、 各1百つ制御装置、ウエハ搬送ロジットおよびレチャル 搬送ロボートを設けたものを立したが、ロガは上のスツ ツハ本体に対し、各1分の制御装置。ウエハ樹送ロホー トおよびレチクル搬送ロホットを設けることもできる。

【0.0.5.8】 もた、フケット本体に仕設される移働すり 低い周辺機器類としては、ウエハ搬送ロボットおよごも チッル搬送ロホットの他、海に挙げる機器がある。

【0059】①レチケルを頂におけら付着壁埃の有無、 20 【図り】(3.6 ごった 打砸倒した チタリ線造ロス・トン機 個数な計劃する「レナクルコニ検査装置」

②マデッハ全体のシーケンスであるご正づを制作、実亡 する「制御装置

③ウエハ主面に感光剤を僅布し、ステッパーそのウエ・、 を供給する「コーター」

④ステットから露光済のウエッを回収し現像処理を行な う テヘロッハー」

#### [0060]

【発明の効果】 料発明は上述のとおり構成されているの で、次に記載するような効果を奏する。

【0061】チャンパ内に配置された各種機器類のほぼ 全体を空調された清浄雰囲気気体にさらすことが可能と なり、従来例に比較してより清净に保つことができると ともに、デッドスペースとなりざるを得なかったチャン **小内の空間にフェルタボックスを配設できるため、チャ** ンパの空間を有効活用することができて小型化すること かできる。

【0062】また。チャン、明の複数の部位でディディ 1995年 新世 1996年 李**春**5 文本 1997年 - 1997年 10 44 4 - - 10 - 10 - 10

(1) (B. 1937) 「P. 4(4) (Chi c 3)れる間辺機器類を1/2/2 と前1組共用できるように設けることにより、アニュービ er til Statistick och som er och skale og fo

#### 【注意《節中型具期】

【以1】な短期の金融装置の第1共矩例の説明問でか

[K2] Standing of the second of the Award 人名西克 医电离肠管电影

【1477】 有条则:"是发展,更是美丽的人民的报告。

第1章# 何至于了一定被把二人,144夏国人大学

【は5】本を明り第2実施包に係るロッケを示ったよう 第2支町付金、は他面図でもる

【図6】 な短期の第3実施供与説明司である

【はて】ほんにおりお髪倒の中の小擦送はなっちの搬送 経路を説明する模式主面はできる

【记》】 图 6 7 分析实施的公第120天中 一个本体,第2 カステルへお体力を含めたい脚さい力 デルカレーサンス 居てある

に経路を説明する様式生面図である

【図10】延長少年資体露光装置の。例を含す説明[47] 7- 5

#### 【符号与晚期】

64500 1. 21

2.22 機械学

2A, 22A 高周監

2B, 22B 再加熱器

2 C. 22 C 辽侧機

30 3. 23 第17字445 75人

За. 4а. 23а, 24а — түңү

4.24 第2ファルタホリケス

### 7 照明光学系

8. 108, 208 レチクルス-デー

9, 109, 209 投影レンス系

10, 110, 210 17.7.7.7.7.--

to the paper. 1 1 1 1 1 1

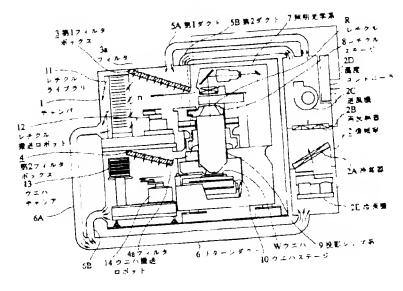
1

15 17 18 18 18

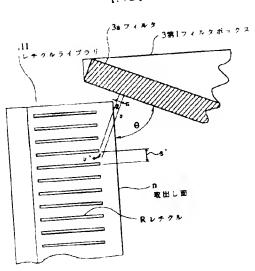
2.4

26 623.1

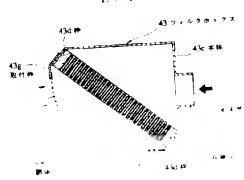
[[41]



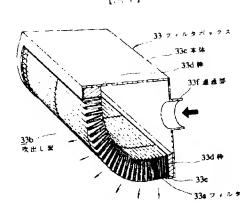
[[\*] 2]



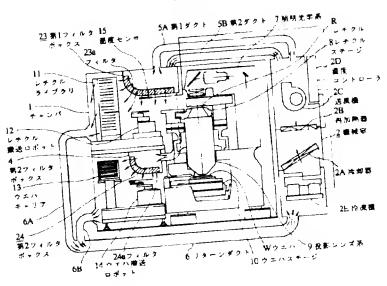
[[4,5]



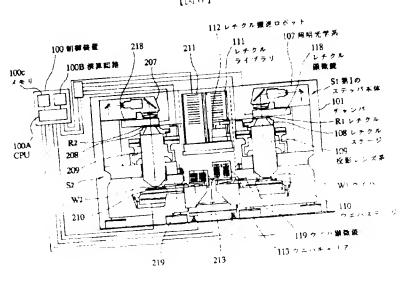
[[4] 4]



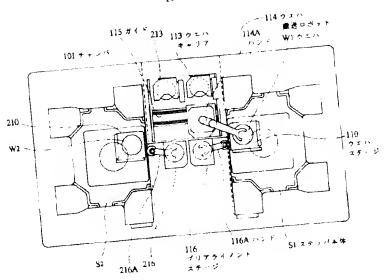
[[4]3]



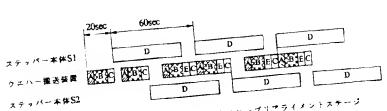
[[46]



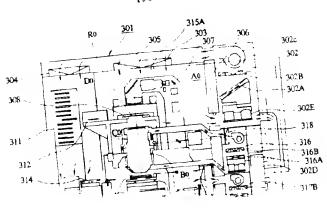
 $I \in \mathbb{Z}J$ 



[[48]



[図10]



Who and 316 W O

## $\{(0,0)\}$

